

中国领先的进口光学精密仪器旗舰型服务商

Shanghai, Tianjin, Shenzhen, Hongkong, Cover business all of China

服务：孚光精仪（香港）有限公司 进口：众邦企业（天津）国际贸易公司

电话：4006-118-227 022-2705 6775

Email: optikschina@gmail.com info@felles-photonic.com

网址：www.fellesoptik.com www.felles-photonic.com(光学精密仪器)

www.felleschina.com (生物光子学和实验室仪器)

光学薄膜测厚仪

这款教学型**光学薄膜测厚仪**是一款低价台式**光学薄膜厚度测量仪**,可测量薄膜厚度,薄膜的吸收率/透过率,薄膜反射率,荧光等,这款**光学薄膜厚度测量仪**也可测量膜层的厚度,光学常量(折射率 n 和 k).

这套**光学薄膜测厚仪**基于白光反射光谱技术,膜层的表面和底面反射的光 VIS/NIR 光谱,也是干涉型号被嵌入的光谱仪收集分析,结合多次反射原理,给出膜层的厚度和光学常数 (n , k).

光学薄膜厚度测量仪到货即可使用,仅仅需要用户准备一台计算机提供 USB 接口即可,操作非常方便。

更多产品参数信息请点击浏览网页: _

<http://www.fellesoptik.com/gallery-146.html> <http://www.fellesoptik.com/product-370.html>

光学薄膜厚度测量仪标准参数

可测膜厚: 100nm-30 微米;

波长范围: 300-1000nm

探测器: 650 像素 Si CCD 阵列, 12bit A/D

精度: 1%

斑点大小: 0.5mm

光源: 钨灯-汞灯 (360-2000nm)

所测样品大小: 10-150mm,

计算机要求: Windows XP, vista, Win7 均可, USB 接口;

尺寸: 320x360x180mm

重量: 9.2kg

光学薄膜测厚仪应用

用于薄膜吸收率,透过率和荧光测量,

用于化学和生物薄膜测量,传感测量

用于光电子薄膜结构测量

用于半导体制造

用于聚合物薄膜测量

在线薄膜测量

光学薄膜厚度测量仪用于光学镀膜测量



中国领先的进口光学精密仪器旗舰型服务商

Shanghai, Tianjin, Shenzhen, Hongkong, Cover business all of China

服务：孚光精仪（香港）有限公司 进口：众邦企业（天津）国际贸易公司

电话：4006-118-227 022-2705 6775

Email: optikschina@gmail.com info@felles-photonic.com

网址：www.fellesoptik.com www.felles-photonic.com(光学精密仪器)

www.felleschina.com (生物光子学和实验室仪器)

薄膜溶解测量仪

这款**薄膜溶解测量仪**用于实时监测薄膜在液体过程中的薄膜厚度和光学常量 (n, k) 的变化。为了这种特色的测量，我们特意为**薄膜溶解分析仪**研发了 Teflon 样品池用于测量薄膜样品，使用一种岔头探针水平安装在 Teflon 样品池的外部，距离玻璃窗口非常接近，使用白光反射光谱技术 (WLRS)，实时测量薄膜厚度和折射率，并通过专业软件记录下这些数据。根据需要，我们还能够在测量区域下安装搅拌装置 stirrer，提供力学激励振动。

我们还特意为该**薄膜溶解测量仪**提供垂直的样品夹具，以固定小尺寸的硅样品或 3", 4"直径的 Si 晶圆。

更多薄膜测厚仪请点击浏览网页：

<http://www.fellesoptik.com/gallery-146.html> <http://www.fellesoptik.com/product-369.html>

薄膜溶解测量仪根据溶解过程的不同，如溶解速度的不同，该**薄膜溶解分析仪**能够以实时或离线的方式测量，反射率数据都能够存储下来以便后续处理使用。

这套**薄膜溶解测量仪**，还能够测量几十个纳米厚度的光致抗蚀剂和聚合物薄膜堆的溶解过程。对于薄膜厚度的测量，**薄膜溶解测量仪**需要光滑，具有反射性的衬底，对于光学常数测量，平整的反射衬底即可满足测量需要。如果衬底是透明的，衬底的背面不能具有反射性。该**薄膜溶解分析仪**能够给出两个参数：例如两个薄膜的厚度或一个薄膜的厚度和光学常量。这套**薄膜溶解测量仪**已经成功应用于测量反射衬底 (Si 晶圆) 上各种光滑，透明或轻度吸收薄膜的溶解过程，可研究的薄膜包括 SiO₂ 薄膜, SiN_x 薄膜, 光致抗蚀剂薄膜，聚合物薄膜层等。

薄膜溶解测量仪, 薄膜溶解分析仪, 水溶薄膜测量仪标准参数

可测膜厚：5nm-150 微米；

波长范围：200-1100nm

精度：0.5%

分辨率：0.02nm

测量点光斑大小：0.5mm

可测样品大小：10-100mm

计算机要求：Windows XP, vista, Win7 均可，USB 接口；

尺寸：360x400x180mm

重量：15kg

薄膜溶解分析仪, 水溶薄膜测量仪电力要求：110/230VAC 薄膜溶解分析仪应用

薄膜溶解分析仪聚合物薄膜测量

水溶薄膜测量仪光致抗蚀剂薄膜测量

薄膜溶解分析仪化学和生物薄膜测量，传感测量

水溶薄膜测量仪光电子薄膜结构测量

水溶薄膜测量仪在线测量

薄膜溶解分析仪, 光学镀膜测量

能够以实时或离线的方式测量，反射率数据都能够存储下来以便后续处理使用。

这款**薄膜溶解测量仪**用于实时监测薄膜在液体中的薄膜厚度和光学常量 (n, k) 的变化, 是测量薄膜溶解速度的**薄膜溶解分析仪**



中国领先的进口光学精密仪器旗舰型服务商

Shanghai, Tianjin, Shenzhen, Hongkong, Cover business all of China

服务：孚光精仪（香港）有限公司 进口：众邦企业（天津）国际贸易公司

电话：4006-118-227 022-2705 6775

Email: optikschina@gmail.com info@felles-photonic.com

网址：www.fellesoptik.com www.felles-photonic.com(光学精密仪器)

www.felleschina.com (生物光子学和实验室仪器)

聚合物薄膜测厚仪



聚合物薄膜测厚仪测量聚合物薄膜和干膜在加热或制冷时薄膜厚度变化,因此又称为干膜测厚仪和干膜厚度测量仪。

更多薄膜厚度测量仪和薄膜测厚仪请点击浏览网页：

<http://www.fellesoptik.com/gallery-146.html> <http://www.fellesoptik.com/product-368.html>

这款**聚合物薄膜测厚仪**用于测量 polymer films（聚合物薄膜、有机薄膜、高分子薄膜）和 photoresist films（光致抗蚀剂薄膜, 光刻胶膜, 光刻薄膜, 光阻膜）在加热或制冷情况下薄膜厚度和光学常量 (n, k) 的变化。为了这种特色的测量, 我们特意研发了专业的软件和算法, 使得该**聚合物薄膜测厚仪**能够给出薄膜的物理化学指标: 例如玻璃化转变温度 glass transition temperature (T_g), 热分解温度 thermal degradation temperature (T_d), 薄膜的厚度测量范围也高达 10nm--100 微米。

这套**干膜厚度测量仪**在传统薄膜测厚仪的基础上添加了加热/制冷的温度控制单元, 使用白光反射光谱技术 (WLRS), 实时测量薄膜厚度和折射率, 并通过专业软件记录下这些数据。

这套**干膜厚度测量仪**能够快速实时给出薄膜厚度和薄膜光学常量等物理化学性能数据, 并且能够控制薄膜加热和制冷的速度, 干膜厚度测量仪是聚合物薄膜特性深入研究的理想工具。干膜测厚仪所使用的软件也适合薄膜的其他热性能研究, 例如: 薄膜的热消融/热剥蚀 thermal ablation 研究, 薄膜光学性质随温度的变化, 薄膜预烘烤 Post Apply Bake, 光刻过程后烘烤 Post Exposure Bake 对薄膜厚度的损失等诸多研究。

对于薄膜的厚度测量, 这款**干膜测厚仪**要求薄膜衬底是透明的, 背面是不反射的。它能够处理最高 4 层薄膜的膜堆 layer stacks, 给出两个参数: 例如两个薄膜的厚度或一个薄膜的厚度和光学常量。

这套**干膜测厚仪**已经成功应用于测量不同聚合物薄膜的热性能, 光刻薄膜的热处理影响分析, Si 晶圆 wafer 上的光致抗蚀剂薄膜分析等。

干膜测厚仪标准参数

可测膜厚: 5nm-150 微米;

波长范围: 200-1100nm

精度: 0.5%

上海 天津 深圳 昆明 香港

中国领先的进口光学精密仪器旗舰型服务商

Shanghai, Tianjin, Shenzhen, Hongkong, Cover business all of China

服务：孚光精仪（香港）有限公司 进口：众邦企业（天津）国际贸易公司

电话：4006-118-227 022-2705 6775

Email: optikschina@gmail.com info@felles-photonic.com

网址：www.fellesoptik.com www.felles-photonic.com(光学精密仪器)

www.felleschina.com (生物光子学和实验室仪器)

聚合物薄膜测厚仪



分辨率：0.02nm

测量点光斑大小：0.5mm

可测样品大小：10-100mm

计算机要求：Windows XP, vista, Win7 均可，USB 接口；

尺寸：360x400x180mm

重量：13.5kg

电力要求：110/230VAC

干膜厚度测量仪 应用

聚合物薄膜测量

光致抗蚀剂薄膜测量

化学和生物薄膜测量，传感测量

光电子薄膜结构测量

干膜测厚仪半导体薄膜厚度测量

干膜测厚仪在线测量

干膜厚度测量仪光学镀膜测量

聚合物薄膜测厚仪聚合物薄膜厚度测量

干膜测厚仪 polymer films 测量

聚合物薄膜测厚仪测量有机薄膜厚度

干膜测厚仪测量光致抗蚀剂薄膜

干膜厚度测量仪测光刻胶膜测厚

干膜厚度测量仪测量光刻薄膜厚度

干膜测厚仪测量光阻薄膜测厚

聚合物薄膜测厚仪测量光阻膜厚度

这款聚合物薄膜测厚仪测量聚合物薄膜和干膜在加热或制冷时薄膜厚度变化,因此又称为干膜厚度测量仪.

薄膜测量系统

这款**薄膜测量系统**是一款超级紧凑而功能多样的**薄膜厚度测试仪系统**，可以结合显微镜测量薄膜的吸收率，透过率，反射率以及测量点的荧光。

整套**薄膜测量系统**的组成是：光栅光谱仪（200-1100nm）+显微镜目镜 适配器+软件+显微镜（可选）。其中目镜适配器包含镜头，可增加光的收集。标准的 40X 物镜可做到测量点直径约 200 微米。更高倍数的物镜的测量点更小。

这款薄膜厚度测试仪通过反射率的测量，测量点处的薄膜厚度，薄膜光学常量（n & k）以及 thick film stacks 都能在瞬间测量出来。

更多薄膜测厚仪资料请点击浏览网页：<http://www.fellesoptik.com/gallery-146.html>

整套薄膜测量系统和薄膜厚度测试仪到货即可使用，仅仅需要用户准备一台计算机提供 USB 接口即可，操作非常方便。

这款薄膜厚度测试仪配备专业的仪器控制，光谱测量和薄膜测量功能的软件，具有广泛的应用范围。该薄膜厚度测试仪软件能够实时采集吸收率，透过率，反射率和荧光光谱，并且能够能够快速计算出结果。

对于吸收率/透过率模式的配置，所有的典型参数如 A, T 可快速计算出来。其他的非标准参数，如 signal integration 也能测量出来。

对于反射率测量，该薄膜厚度测试仪软件能够精确测量膜层小于 10 层薄膜厚度（《10nm 到 100 微米），光学常量（n & k）。

薄膜厚度测试仪标准参数

可测膜厚： 5nm-150 微米；

波长范围： 200-1100nm

精度： 0.5%

分辨率： 0.02nm

光源： 使用显微镜光源

光斑大小： 由显微镜物镜决定

计算机要求： Windows XP, vista, Win7 均可，USB 接口；

尺寸： 120x120x120mm

重量： 1.2kg

薄膜厚度测试仪应用

薄膜测量系统测量薄膜吸收率,透过率

薄膜测量系统测量化学薄膜和生物薄膜测量

薄膜厚度测试仪光电子薄膜结构测量

薄膜测量系统半导体制造

薄膜厚度测试仪聚合物测量

薄膜测量系统在线测量

薄膜测量系统光学镀膜测量

这款薄膜测量系统是超功能多样的薄膜厚度测试仪,结合显微镜测量薄膜厚度,折射率和消光系数等



中国领先的进口光学精密仪器旗舰型服务商

Shanghai, Tianjin, Shenzhen, Hongkong, Cover business all of China

服务：孚光精仪（香港）有限公司 进口：众邦企业（天津）国际贸易公司

电话：4006-118-227 022-2705 6775

Email: optikschina@gmail.com info@felles-photonic.com

网址：www.fellesoptik.com www.felles-photonic.com(光学精密仪器)

www.felleschina.com (生物光子学和实验室仪器)

薄膜厚度测量系统



这款**薄膜厚度测量系统**平台是一种模块化设计的**薄膜厚度测量仪**，可灵活扩展成精密的薄膜测量仪器，可在此基础上衍生出多种基于白光反射光谱技术的**薄膜厚度测试仪**，比如标准吸收/透过率，反射率的测量，薄膜的测量，薄膜温度和厚度的测量。

更多薄膜厚度测量仪资料请浏览网页：<http://www.fellesoptik.com/gallery-146.html>

这个**薄膜厚度测量系统**由如下 5 个模块组成：

核心模块----光谱仪；

外壳模块----各种精密精美的仪器外壳；

工作面积模块----测量工作区域；

光纤模块----根据不同测量任务配备各种光纤附件；

测量室-/环境罩---给测量带去超净工作区域。

薄膜厚度测量仪核心模块---光谱仪

我们提供多种光谱仪类型，不同光谱范围和光源，**薄膜厚度测量仪**满足各种测量应用